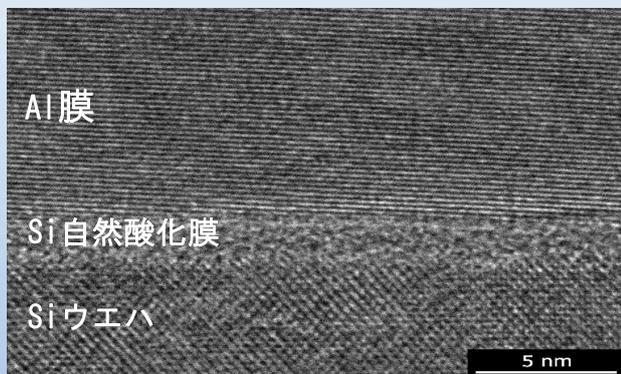


# イオンミリング装置 Ion Milling System IE-30

Si基板上のAlの例



東京工業大学 春本先生 ご提供



## ■概要

- ・アルゴンイオンを試料に当てて試料表面を削り、透過電子顕微鏡（TEM）観察用試料を作製する装置です。

## ■特長

- ・ $0^{\circ}$  ~  $10^{\circ}$  まで、イオンビームの入射角を変えることができます。
- ・CCDカメラの映像をパソコン上に表示することができ、試料の確認が簡単にできます。

## ■仕様

1. イオンガン : ペニングイオンガン×2式
2. 加速電圧 :  $0\sim 5\text{kV}$
3. ミリング角度 :  $\pm 10^{\circ}$
4. サンプルサイズ :  $\phi 3\text{mm}$
5. 試料回転 :  $1\sim 6\text{rpm}$
6. 到達圧力 :  $6.5 \times 10^{-4}\text{Pa}$ 以下
7. 寸法 :  $610\text{mm (W)} \times 620\text{mm (D)} \times 655\text{mm (H)}$
8. 重量 :  $80\text{Kg}$  (PC及びドライポンプを除く)
9. 入力電源 : AC100V, 10A